

DZIEŃ 3 – 06.10.2017 (piątek)

8:00 – 9:00 – śniadanie

9.30 – 10.30 – Sesja VI

Inż. Artur Kopa: Prezentacja sprzętu: Mobilne pomiary 1D i 2D z wykorzystaniem laserowego systemu pomiarowego GapGun PRO.

10:30 - 10:45 – przerwa kawowa

10.45 – 12.15 – Sesja VI

Mgr inż. Tatiana Miller: Rozwój metod pomiarowych w zakresie topografii powierzchni a jakość wykonywanych pomiarów

Mgr inż. Jacek Świdorski: Rola wzorców programowanych w walidacji oprogramowania do analizy struktury geometrycznej powierzchni

Dr inż. Paweł Jarka, Dr inż. Marcin Staszuk, Dr inż. Bogusław Ziębowicz: Zastosowanie mikroskopii sił atomowych w badaniach topografii powierzchni materiałów

Prof. Marek Roszak, mgr inż. Krystian Kurasz: Współrzędnościowa technika pomiarowa a statystyczna kontrola wielkości geometrycznych wyrobu

12:15 – 12:30 – zakończenie obrad

13:00 – 14:00 – obiad



Symposium

PROGRAM

METROLOGIA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA - 8

„Metrologia podstawą systemu oceny zgodności”

Patronat merytoryczny:

JM Rektor Politechniki Śląskiej

Patronat honorowy:



Patronat medialny:



04 – 06 października 2017 r.
Hotel *Qubus*, Kielce

DZIEŃ 1 – 04.10.2017 (środa)

od 12.00 Rejestracja uczestników

(uwaga: zakwaterowanie w pokojach od godz. 14.00
lub wcześniej w miarę dostępności)

14:00 – 14:45 - obiad

15:00 – 16:30 – Sesja plenarna

15.00 – 15.30 Wystąpienia zaproszonych Gości

Prof. Alicja Maleszka: Doskonalenie zarządzania procesami poprzez poprawne wykorzystanie wskaźników do ich oceny

16:30 – 16:45 – przerwa kawowa

16:45 – 18:15 – Sesja I

Dr inż. Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas, mgr Grażyna Żarlicka: Podejście do wymagań metrologicznych w systemach zarządzania według nowych norm systemowych

Mgr inż. Jacek Pilecki: Wymagania i praktyka oceny zgodności wag nieautomatycznych. Doskonalenie nadzoru

19:00 – kolacja towarzyska (grillowa)

DZIEŃ 2 – 05.10.2017 (czwartek)

8:00 – 9:00 – śniadanie

9:00 – 10:30 – Sesja II

Mgr inż. Tadeusz Matras, dr Anna Kęsik, PCA: Zasada podejmowania decyzji w działalności laboratoriów wg znowelizowanych wymagań normy ISO/IEC 17025

Dr inż. Paweł Fotowicz, GUM: Wpływ metodyki wyznaczania niepewności pomiaru, wynikającej z zaleceń Przewodnika ISO/IEC Guide 98-3, na procedury opracowania wyniku pomiaru w laboratoriach badawczych i wzorcujących

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa

10:45 – 12:15 – Sesja III

Mgr inż. Anna Jarońska, PKN: Normalizacja w zakresie metrologii – perspektywy publikacji opracowań w języku polskim
Referat wygłosi Pan mgr inż. Tomasz Mazur, Kierownik Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji PKN

Mgr Jacek Podlewski: Bezbłędne podejście do błędów pomiarowych z Zestawem Laboratoryjnym StatSoft Polska

13:00 – 15:00 – obiad, przerwa

15:00 – 16:30 – Sesja IV

Dr inż. Joanna Wiśniewska, GUM: Zarządzanie ryzykiem narzędziem do doskonalenia systemu nadzoru nad przyrządami pomiarowymi na rzecz ochrony interesu publicznego

Dr Edyta Słupecka, Prof. Marek Roszak: Wzmocnienie funkcji metrologicznej jako efekt systemowego zarządzania ryzykiem w laboratorium badawczym

16:30 – 16:45 – przerwa kawowa

16:45 – 18:15 – Sesja V

Dr inż. Maciej Sieniło: Pomiary wymiarów i odchyłek kształtu elementów obrotowych na maszynach FMM

Mgr inż. Michał Solecki: Automatyzacja procesu wzorcowania wzorców masy i odważników oraz jej wpływ na poprawę parametru powtarzalności komparatorów masy

Inż. Artur Kopa, Prof. Marek Roszak: Zarządzanie wyposażeniem pomiarowym zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 w komputerowej chmurze z wykorzystaniem aplikacji NEOGAGE.

19:30 – uroczysta kolacja